

Ⅰ 施設使用料:ⅠⅠ施設(Ⅰ時間当たりの金額:円)

施設名	可否
大会議室(Ⅰ08席)	×
中研修室(42席)	×
小研修室(20席)	×
産学交流室(30席)	×
小会議室(Ⅰ2席)	×
電波暗室	○
Ⅰ0m法電波暗室	○
実用化研究室	○
クリーンルーム	○
シールドルーム	○
講師控室	×

凡例

○:御利用可能です。

△:条件付きで御利用可能です。機器により条件は異なりますので事前にお問い合わせ下さい。

×:御利用いただけません。

2 機器使用料:242機器(Ⅰ時間当たりの金額:円)

精密測定関連機器(Ⅰ0機器)	可否
工具顕微鏡	△
三次元座標測定機	△
真円度測定機	△
超精密表面粗さ測定機	△
非接触三次元表面粗さ測定機	△
表面粗さ・形状測定機	△
非接触三次元測定機	△
非接触三次元平面度測定機	△
超精密非接触三次元形状評価装置	△
ワンショット測定顕微鏡	△

材料加工関連機器(49機器)	可否
加工特性評価システム	×
カットオフマシン	○
機械的特性評価試験機	○
高温焼成実験炉	×
高速精密カッティング	△
射出成型機	△
スライシングマシン	△
ツインロックウェル硬さ試験機	○
電気炉	△
熱間等方圧プレス	×
引張圧縮試験機	△
複合材料作製用オートクレーブ	○

材料加工関連機器(49機器)	可否
粉碎機	△
放電プラズマ焼結機	△
真空ホットプレス(VHP)	△
マイクロ스코ープ	△
マイクロスライサー	△
超精密CNC成形平面研削盤	△
高速NCフライス盤	△
大型ホットプレス	○
加圧型ニーダー	△
スーパーミキサー	△
ビッカース硬度計	○
マイクロビッカース硬度計	×
レーザー回折散乱式粒度分布測定装置	△
気流式粉碎機	○
五軸マシニングセンタ	△
電子顕微鏡試料作成用スライサー	○
メルトインデックサ	△
超音波厚さ計	○
衝撃試験装置	○
高分子材料コンパウンド装置	△
クリープ試験機	△
樹脂流動解析ソフトウェア	△
工具評価用電子顕微鏡	△
高速引張圧縮試験機	△
光沢計	○

材料加工関連機器(49機器)	可否
分光色彩計	○
分光変角色差計	○
3D超音波検査装置	○
平面研削盤	△
超音波援用加工装置	△
ハイスピードカメラ	△
マイクロスコープ(DMS1000)	△
自動研磨機	○
精密自動切断機	○
振動研磨機	○
ダイヤモンドワイヤーソー	○
送風定温恒温器	○

電子・情報関連機器(76機器)	可否
静電気放電イミューニティ試験装置	○
デジタルオシロスコープ	○
電圧ディップ瞬時電圧変動試験装置	○
電源高調波・フリッカ測定装置	○
電源周波数磁界イミューニティ試験装置	○
ネットワークインピーダンスアナライザ	○
LCRメータ	○
インピーダンスアナライザ	○
多チャンネル電流測定器	○
電力増幅器	○
薄膜透磁率測定システム	○
マイクロ波プローバ	○
磁気シールドケース	○
FEM磁場シミュレータ	○
モーダル解析ソフトウェア	○
振動データ収集システム	○
非接触レーザ振動計	○
加振システム	○
電波暗室測定システム	○
伝導EMC試験システム	○
10m法放射エミッション測定システム	○
アンテナ照射試験システム	○
車載機器用イミューニティ試験システム	○
高周波スペクトル測定装置	○
FTB試験装置	○

電子・情報関連機器(76機器)	可否
デジタルマルチメータ	○
耐電圧試験機	○
通信アルゴリズムシミュレータ	○
フラックスゲート磁力計	○
ガウスメータ	○
電圧発生器	○
ベクトルネットワークアナライザ	○
任意波形発生器	○
超低温恒温恒湿槽	○
酸化・拡散炉	○
スパッタ装置	○
顕微鏡式薄膜測定装置	○
触針式段差計	○
TDR装置	○
測定機能付精密電流・電圧源(ソースメータ)	○
紫外線照度計	○
高周波電磁界解析シミュレータ	○
ロックインアンプ	○
高速電力増幅器	○
熱衝撃試験機	○
BCI試験機	○
静電気放電イミューニティ試験装置Ⅱ	○
車載用伝導エミッション測定装置	○
車載用放射エミッション測定装置	○
両面マスクアライナー	○
スピンコーター	○
高性能信号発生器	○
リアルタイムスペクトラムアナライザ	○
熱ナノインプリント装置	△
静電気測定機	○
顕微鏡機能付き赤外線サーモグラフィ	○
全光束測定システム	○
通信プロトコル解析機能付きデジタルオシロスコープ	○
振動試験装置	○
複合環境試験用恒温恒湿槽	○
車載電装品用試験電源	○
二次元色彩輝度計	○
過渡サージ試験装置	○

電子・情報関連機器(76機器)	可否
雷サージ試験装置	○
ベクトルネットワークアナライザ(Ⅱ)	○
プリント基板加工装置	○
ポータブル3Dデジタイザ	○
医用積層画像処理ソフトウェア	△
磁場中熱処理装置	○
カー効果顕微鏡	○
振動試料型磁力計	○
電源ノイズアナライザ	○
リアルタイムスペクトラムアナライザ(RSA)	○
外観検査用AIシステム	○
ハイパースペクトルカメラ	○
非接触画像光学式三次元デジタイザ (FLARE)	○

工業デザイン関連機器(16機器)	可否
CAEシステムワークステーション	○
真空注型機	○
光造形システム(Ⅲ)iPRO	×
ウェットブラスト装置	○
光造形システム(Ⅳ)Projet	×
熱溶解積層造形システム	○
小型彫刻機	○
レーザーカッターシステム	○
三次元CADシステム	○
CAD連携CAEシステム	○
UVプリンター	○
グラフィック処理システム	○
エンジニアリングプラスチック造形システム	○
アーム式デジタイザ(ベクトロン)	○
流体CAEシステム	○
CAE検証用計測システム	○

食品・バイオテクノロジー関連機器(50機器)	可否
温度勾配恒温機	○
乾燥機	○
真空ガス置換包装機	○
生物顕微鏡システム	○
窒素分析装置	○

食品・バイオテクノロジー関連機器(50機器)	可否
超低温フリーザー	○
融砕機(マスコロイダ)	○
ロータリーエバポレータ	○
クリーンベンチ(MHE-130AJ)	○
恒温振とう器	○
遠心分離機	○
高速液体クロマトグラフ	○
テクスチャー評価装置	○
滅菌用オートクレーブ	○
ケミルミネッセンスアナライザ	○
味評価装置	○
香り評価装置	○
飽和蒸気調理機	○
官能評価装置付ガスクロマトグラフ質量分析 装置	○
蛍光マイクロプレートリーダー	○
インキュベータ	○
サイレントカッター	○
採肉機	○
卓上型万能高速カッター・ミキサー	○
食品脱水機	○
魚体処理機	○
腸詰機	○
スチームコンベクションオーブン	○
両面焼成調理機	○
卓上型小型包あん機	○
小型レトルト殺菌装置	○
減圧加熱調理機	○
缶詰巻き締め機	○
食品熱量測定装置(Ⅰ)CA-HN	○
恒温恒湿槽	○
高速液体クロマトグラフ(Chromaster)	○
ヘッドスペースガスクロマトグラフ (HS20/GC2030)	○
吸光マイクロプレートリーダー	○
マイクロプレートウォッシャー	○
水分活性測定装置	○
食品熱量測定装置(Ⅱ)CA-HM	○
紫外可視分光光度計	○

食品・バイオテクノロジー関連機器(50機器)	可否
モバイル分光測色計	○
大型オートクレーブ	○
サーマルタンク500	○
クリーンベンチ(VSF-1301)	○
酒造用タンク360	○
大容量冷却遠心分離機	○
真空凍結乾燥機	○
オートサンプラー付GC-MS/O	○

分析・測定関連機器(41機器)	可否
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF)	△
誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-OES)	△
X線光電子分光分析装置(XPS-Nexsa)	△
微小部蛍光X線分析装置(μ -XRF)	△
炭素・硫黄同時分析装置	○
熱分析システム(TG/DTA, DSC, TMA, DMA)	○
電子天秤	○
接触角計	○
蛍光分光光度計	○
電界放出型電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	△
レーザー顕微鏡	△
ガスクロマトグラフ	△
超高速液体クロマトグラフ質量分析システム	○
フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)	△
多目的X線回折装置(XRD)	△
走査型電子顕微鏡	△
イオン研磨装置	△
倒立型金属顕微鏡	○
加熱加圧埋込機	○
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)	△
スパーク放電発光分光分析装置	○
ラマン分光光度計	△
レオメーター(MCR302)	△
DNAシーケンサ	○
遺伝情報解析ソフトウェア	○

分析・測定関連機器(41機器)	可否
PCRサーマルサイクラ	○
冷却遠心分離機	○
微量分光光度計	○
電気泳動ゲル撮影装置	○
アンプル用凍結乾燥装置	○
アンプル熔閉器	○
波長分散型蛍光X線分析装置(WDXRF)	△
ガラスビード作製装置	○
紫外可視近赤外分光光度計	△
高温対応微弱発光検出装置 (HT-CLA)	△
シャルピー衝撃試験機 (シャルピー)	△
マイクロフォーカスX線CT装置	○
マイクロフォーカスX線透過装置	○
ポータブル型X線残留応力測定装置	○
サブミクロン三次元X線顕微鏡(XRM)	○
卓上型高速X線CT装置(高速XCT)	○

料金と詳細はこちら↓のQRコードから

「機器使用料一覧」

「施設一覧(料金表)」

をクリック

